

出願人:山口大学 発明者:只友一行 特開WO2013-128894 特許第6019541号

発明の名称:半導体発光素子



利用:用途:応用分野

半導体レーザ、発光ダイオード

目的:課題

主面が非極性面であるIII族窒化物半導体を用いた半導体発光素子では、多重量子井戸層に含まれるInGaNで形成された井戸層に欠陥が入りやすいという構造的な欠点があり、物性の利点を十分に生かしきれていなかった。

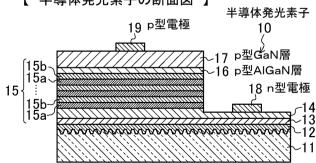
研究概要・アピールポイント

- ◆主面が{11-22}面のGaN層と、GaN層の直上にIn_xGa_{1-x}N(0.01 <x<0.05)がエピタキシャル成長して形成され、n型ドーパントを含有した厚さ0.2μm以上のInGaN層と、上記InGaN層の直上にエピタキシャル成長して形成され、InGaNで形成された井戸層を含む紫色に発光するように構成された多重量子井戸層を備える。
- ◆InGaN層は、GaN層との間の 格子不整合による歪みが完全に又は 部分的に緩和しており、多重量子井 戸層の発光波長に対する発光強度 分布の半値全幅が40nm以下の 半導体発光素子。
- ◆基板がサファイア基板である半導体 発光素子。

解決ポイント

PL発光強度を測定し、リファレンスを基準と したPL発光強度の倍率を求めた。 n型InGaN層におけるInの含有割合xが 0<x<0.1の範囲においてPL発光強度 の倍率は、1よりも大きく、高い発光効率を 得ることができる。 特に0.01<x<0.05の範囲において、 また紫色の発光をするものにおいて顕著に 高い発光効率が得られた。 逆格子空間マッピング測定を行い少なくとも n型InGaN層におけるInの含有割合xが 0<x<0.15の範囲にあるものについて n型InGaN層は、n型GaN層との間の格子 不整合による歪みが完全に又は部分的に 緩和していることが確認された。「完全緩 和とは、InGaN層が下地のGaN層に対し て100%緩和していることを意味し、「部分 緩和」とは、緩和率>0であると定義する。

【 半導体発光素子の断面図 】



15 多重量子井戸層 15a 障壁層

15b 井戸層

11 基板 12 u-GaN層 13 n型GaN層

14 n型InGaN層

◆ お問合せ先 ◆

有限会社山口ティー・エル・オー TEL: 0836-22-9768 E-mail:tlojim@yamaguchi-u.ac.jp